

552,677

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Oktober 2004 (21.10.2004)

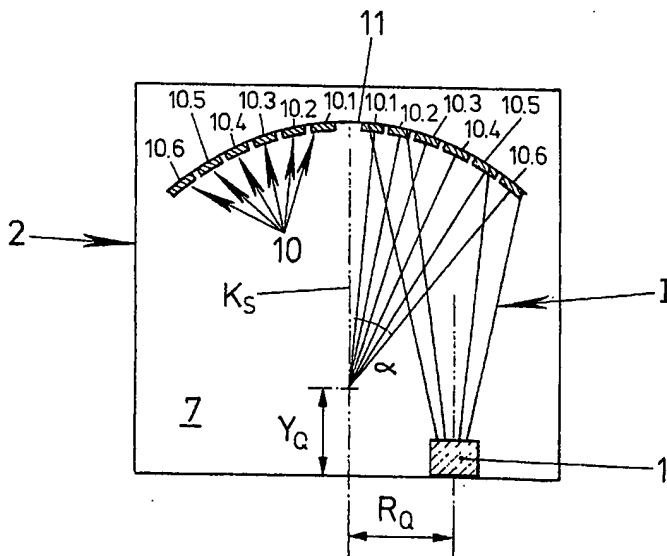
PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/091264 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H05H** (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): BECKMANN, Rudolf
[DE/DE]; Am Katzengraben 35, 63546 Hammersbach
(DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/003796
- (22) Internationales Anmeldedatum:
8. April 2004 (08.04.2004) (74) Anwalt: POHLMANN, Bernd, Michael; Reinhardt &
Pohlmann Partnerschaft, Günthersburgallee 40, 60316
Frankfurt am Main (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart*): AB, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
103 17 027.8 11. April 2003 (11.04.2003) DE
- (71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US*): LEYBOLD OPTICS GMBH [DE/DE];
Siemensstrasse 86, 63755 Alzenau (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HIGH FREQUENCY PLASMA JET SOURCE AND METHOD FOR IRRADIATING A SURFACE

(54) Bezeichnung: HOCHFREQUENZ-PLASMASTRAHLQUELLE UND VERFAHREN ZUM BESTRAHLEN EINER OBER-
FLÄCHE

(57) Abstract: The invention relates to a high frequency plasma jet source (1) comprising a space (3) for accommodating a plasma, electrical means (8, 9) for applying a voltage to said high frequency plasma jet source (1) so as to ignite and obtain the plasma, means (4) for extracting a plasma jet (I) from the plasma space (3), and an outlet port which is separated from the vacuum chamber (7) by means of an extraction grid (4). The plasma jet (I) emerges from the high frequency plasma jet source (1) with essentially divergent radiation characteristics. The invention further relates to a method for irradiating a surface with a plasma jet (I) of a high frequency plasma jet source, said plasma jet (I) being divergent.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/091264 A2